

가



1995 6
2000

가

가

가 가,

가 가

(low-temperature atomic
layer deposition) '

(aluminum oxide,

)

(Georgia Institute of Technology)

(Morpho peleides butterfly)

가

10nm() 40nm

가

가

가

가 (funnel weaver spider)

가

가 가

가 가

6 가

25%

가

가 가

(Rhex)

가 가

6

가 가

가

가

가

가

가 가

가



